


ZAKRES AKREDYTACJI
LABORATORIUM WZORCUJĄCEGO
SCOPE OF ACCREDITATION FOR CALIBRATION LABORATORY
Nr/No AP 236

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 1 z/of 02.02.2026

 AP 236	Nazwa i adres / Name and address Lab-WP Wojciech Płowucha Os. Pod Grapą 6/3 34-300 Żywiec
Działalność prowadzona / Activity conducted poza stałą lokalizacją (P) / outside of permanent location (P)	Wzorcowanie / Calibration: Numer i nazwa wielkości mierzonej / number and name of measurand ¹⁾ 6.01 długość 6.02 kąt 6.04 długość (pomiar współrzędnościowe)

Wersja strony/Page version: A

¹⁾ Numeracja wielkości mierzonych zgodna z podaną w załączniku nr 1 do dokumentu DAP-04 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl / The numbering of measurand in accordance with the classification given in the Annex to document DAP-04, available at PCA website www.pca.gov.pl

KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI
WZORCOWAŃ

KATARZYNA WIŚNIEWSKA

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AP 236 z dnia 02.02.2026 r.
Cykl akredytacji od 02.02.2026 r. do 01.02.2030 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl

This document is an annex to accreditation certificate No. AP 236 of 02.02.2026
Accreditation cycle from 02.02.2026 to 01.02.2030
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl

Laboratorium Lab-WP Os. Pod Grapą 6/3, 34-300 Żywiec				
Obiekt wzorcowania/pomiaru	Zakres pomiarowy	Niepewność pomiaru dla CMC	Miejsce dział.	Metoda pomiarowa
Długość				
Długościomierze pionowe Abbego	0 mm do 100 mm	$(0,1 + 2 \cdot L) \mu\text{m}$ <i>L</i> - wielkość mierzona (m)	P	Procedura wewnętrzna PWZ-1 Metoda bezpośrednia
Długościomierze poziome Abbego	0 mm do 1000 mm	$(0,1 + 2 \cdot L) \mu\text{m}$ <i>L</i> - wielkość mierzona (m)	P	Procedura wewnętrzna PWZ-1 Metoda bezpośrednia
Długościomierze poziome (maszyny 1-D)	0 mm do 1000 mm 1000 mm do 1900 mm 1900 mm do 2700 mm	$(0,1 + 2 \cdot L) \mu\text{m}$ $(0,4 + 2 \cdot L) \mu\text{m}$ $(0,6 + 2 \cdot L) \mu\text{m}$ <i>L</i> - wielkość mierzona (m)	P	Procedura wewnętrzna PWZ-1 Metoda bezpośrednia
Mikroskopy pomiarowe uniwersalne Mikroskopy pomiarowe warsztatowe	0 mm do 25 mm 25 mm do 500 mm 500 mm do 1000 mm 1000 mm do 1500 mm 1500 mm do 2000 mm	$(0,35 + L) \mu\text{m}$ $(0,4 + 2,5 \cdot L) \mu\text{m}$ $(0,5 + 3 \cdot L) \mu\text{m}$ $(0,7 + 3 \cdot L) \mu\text{m}$ $(0,9 + 3 \cdot L) \mu\text{m}$ <i>L</i> - wielkość mierzona (m)	P	Procedura wewnętrzna PWZ-1 Metoda bezpośrednia
Projektory pomiarowe	0 mm do 500 mm	$(0,3 + 3 \cdot L) \mu\text{m}$ <i>L</i> - wielkość mierzona (m)	P	Procedura wewnętrzna PWZ-1 Metoda bezpośrednia
Wysokościomierze cyfrowe o rozdzielczości: - 0,01 mm - 0,005 mm - 0,001 mm - 0,0005 mm - 0,0001 mm	0 mm do 1000 mm	6 μm 3,5 μm $(0,6 + 2 \cdot L) \mu\text{m}$ $(0,3 + 2,5 \cdot L) \mu\text{m}$ $(0,3 + 2,5 \cdot L) \mu\text{m}$ <i>L</i> - wielkość mierzona (m)	P	PN-EN ISO 13225:2012
Kąt				
Mikroskopy pomiarowe uniwersalne Mikroskopy pomiarowe warsztatowe Projektory pomiarowe	0° do 360°	2'	P	Procedura wewnętrzna PWZ-1 Metoda bezpośrednia

Wersja strony: A

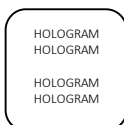
Obiekt wzorcowania/pomiaru	Zakres pomiarowy	Niepewność pomiaru dla CMC	Miejsce dział.	Metoda pomiarowa
Długość (pomiar współrzędnościowe)				
Główce pomiarowe stykowe Główce pomiarowe stykowe impulsowe Główce pomiarowe stykowe skanujące	0 mm do 25 mm	0,14 μm	P	PN-EN ISO 10360-5:2020-10
Współrzędnościowe maszyny pomiarowe z głowicą pomiarową stykową	0 mm do 1515 mm 1515 mm do 2880 mm 2880 mm do 4090 mm	(0,2 + 0,5 · L) μm (0,3 + 0,6 · L) μm (0,4 + 0,7 · L) μm L - wielkość mierzona (m)	P	PN-EN ISO 10360-2:2010
Optyczne współrzędnościowe maszyny pomiarowe z głowicą pomiarową rejestrującą obraz	0 mm do 758 mm	(0,3 + 0,6 · L) μm L - wielkość mierzona (m)	P	PN-EN ISO 10360-7:2011
Optyczne współrzędnościowe mikroskopy pomiarowe	0 mm do 758 mm	(0,3 + 0,6 · L) μm L - wielkość mierzona (m)	P	PN-EN ISO 10360-7:2011
Optyczne współrzędnościowe projektory pomiarowe	0 mm do 758 mm	(0,3 + 0,6 · L) μm L - wielkość mierzona (m)	P	PN-EN ISO 10360-7:2011
Współrzędnościowe ramiona pomiarowe z głowicą pomiarową stykową	0 mm do 4500 mm	(4 + 1 · L) μm L - wielkość mierzona (m)	P	ASME B89.4.22:2004 PN-EN ISO 10360-12:2017
Współrzędnościowe systemy pomiarowe z głowicą pomiarową optyczną mierzącą odległość: - współrzędnościowe maszyny pomiarowe - współrzędnościowe ramiona pomiarowe - współrzędnościowe skanery optyczne	0 mm do 1500 mm	(2 + 1 · L) μm L - wielkość mierzona (m)	P	VDI/VDE 2634 Błat 2 2012 VDI/VDE 2634 Błat 3 2008 PN-EN ISO 10360-8:2014 PN-EN ISO 10360-13:2022

Wersja strony: A

Niepewność pomiaru dla CMC stanowi niepewność rozszerzoną przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95 %. Niepewność pomiaru dla CMC wyrażona jest w jednostkach wielkości mierzonej.

Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AP 236

Status zmian: wersja pierwotna – A



Zatwierdzam status zmian

**KIEROWNIK
DZIAŁU AKREDYTACJI WZORCOWAŃ**

KATARZYNA WIŚNIEWSKA
dnia: 02.02.2026 r.